文章编号: 1001-3806(2003)03-0220-03

厄米-高斯光束通过光阑-透镜系统的聚焦特性^{*}

彭润伍 吕百达

(四川大学激光物理与化学研究所,成都,610064)

摘要:使用 Collins 公式研究了厄米-高斯光束通过光阑-透镜分离光学系统的聚焦特性。利用数值计算详细分析和说明了偶数模厄米-高斯光束的轴上光强分布和焦移。分析得出,选择恰当的光束和光学系统参数可引起焦移相反或无焦移。特别是对于 TEM₂₂模厄米-高斯光束,在几何焦面两边存在两个相等的轴上光强极大点,故存在两个符号相反的焦移。

关键词: 厄米-高斯光束;光阑-透镜分离光学系统;聚焦特性;焦移 中图分类号: TN241 **文献标识码**: A

Focusing properties of Hermite-Gaussian beams passing through an aperture-lens system

Peng Runwu, L ÜBaida

(Institute of Laser Physics and Chemistry, Sichuan University, Chengdu, 610064)

Abstract: The focusing properties of Hermite-Gaussian (HG) beams in passage through an aperture-lens separation optical system are studied based on the Collins formula. The axial intensity distribution and focal shift of HG beams with even mode numbers are analyzed and illustrated with detailed numerical examples. It is found that the inverse focal shift and focusing without focal shift can be achieved by a suitable choice of the beam and optical system parameters. In particular, for the TEM₂₂-mode HG beam, there may be two equal axial maximum intensity points located on two sides of the geometrical focal plane, thus there are two focal shifts with opposite signs.

Key words : Hermite Gaussian beam ; aperture-lens separation optical system ; focusing property ; focal shift

引 言

当会聚光束通过光阑发生衍射后,其光强极大 值点不在几何焦点上,而是更靠近透镜一些。这是 熟知的焦移现象,对此已有广泛的研究^[1~11]。其中 大部分讨论的是光阑和透镜位于同一平面的情况, 得出焦移朝向透镜并主要受菲涅耳数影响的结论。 只有少部分讨论光阑-透镜分离系统,得出焦移可能 相反或消失,但其讨论对象仅是平面波^[11]。而在激 光的实际应用中常遇到多模高斯光束,所以对多模 高斯光束焦移的讨论有很大的实际意义。

笔者对厄米-高斯光束通过光阑-透镜分离光学 系统的聚焦特性作了研究。首先,使用 Collins 公式 推导了厄米-高斯光束通过光阑-透镜分离光学系统 的光强分布,得出了其焦移的表达式。然后,利用得 出的公式进行了数值计算,并对所得结果作了深入 分析,得到一些新的结果。

厄米-高斯光束通过光阑-透镜分离光学系
 统的光强分布

假设厄米-高斯(H-G)光束 通过如图 1 所 示的光阑-透镜 分离光学系统, 并设 H-G 光束 束腰位于光阑



平面处。图中正方形硬边光阑的边长为 2*a*,光阑与 焦距为 *f* 的薄透镜的距离为 *s*, *F* 为薄透镜的后焦 点, *Z* 为观察点 *P* 到 *F* 的距离, *O* 为薄透镜的中心。 设入射光阑平面的 H-G光束场分布为:

system

$$E_{mn}(x_0, y_0) = \mathbf{H}_m \left(\sqrt{2} \ \frac{x_0}{w_0} \right) \mathbf{H}_n \left(\sqrt{2} \ \frac{y_0}{w_0} \right) \mathbf{x}$$

^{*} 华中科技大学激光技术国家重点实验室资助项目。 作者简介:彭润伍,男,1971年5月出生。硕士研究 生。从事激光传输变换的研究。

收稿日期:2002-03-12;收到修改稿日期:2002-06-28

$$\exp\left[-\left(\frac{\mathbf{i}k}{2q_0}\right)\left(x_0^2 + y_0^2\right)\right] \tag{1}$$

式中, $\frac{1}{q_0} = -i \frac{2}{w_0^2} = \frac{2}{i k w_0^2}$ 为与入射光束相关的基 模高斯光束的复参数, w_0 为HG光束对应基模高 斯光束的束腰宽度,为波长, k为波数。H_m, H_n 为 m 和 n 阶厄米多项式。

从光阑平面到观察点 P 的变换矩阵为:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -Z/f & -sZf + f + Z \\ -1/f & 1 - s/f \end{bmatrix}$$
(2)
h Collins 公式得观察点 *P* 的场分布为^[1,12]:

$$E_{mn}(x, y, z) = \frac{1k}{2} \exp[-ik(f + Z)] \times$$

$$a = a = E_{mn}(x_0, y_0) \exp\{-\frac{ik}{2B}[A(x_0^2 + y_0^2) - \frac{ik}{2B}(x_0 - x_0^2)] + \frac{ik}{2B}(x_0^2 - x_0^2) + \frac{ik}{2B}(x_0 - x_0^2) + \frac{ik}{2B}(x_0 - x_0^2) + \frac{ik}{2B}(x_0 - x_0^2)) + \frac{ik}{2B}(x_0 - x_0^2) + \frac{ik}{2B}(x_0 - x_0^2) + \frac{ik}{2B}(x_0 - x_0^2))$$

$$2(x_0 x + y_0 y) + D(x^2 + y^2)$$
]}dx_0dy_0 (3)
现在讨论轴上的情况,即 x = 0, y = 0,得:

$$E_{mn}(z) = \frac{ik}{2} \exp[-ik(f+Z)] \times \frac{a}{2} \frac{a}{B} \exp[-ik(f+Z)] \times \exp\left[-\frac{a}{2} \frac{a}{W_0} + \frac{a}{W_0} \frac{2}{W_0} \frac{x_0}{W_0} + \frac{1}{2} \frac{y_0}{W_0} \frac{x_0}{W_0} + \frac{x_0^2 + y_0^2}{W_0^2} \exp[-\frac{ikA}{2B}(x_0^2 + y_0^2)] dx_0 dy_0\right]$$

由厄米多项式的奇偶性可知,当 *m* 或 *n* 为奇数时, $E_{mn}(z) = 0$ (*m* 或 *n* = 2*k* + 1, *k* = 0, 1, 2, ...), 轴上 光强为 0。当 *m* 或 *n* 为偶数时, 轴上光强才不为 0。 这里仅限于讨论 *m*, *n* 均为偶数情况。令 $x_1 = x_0/w_0$, $y_1 = y_0/w_0$, 并且: $= a^2/w_0^2$ (5)

$$N_w = w_0^2 / f$$
 (6)

表示截断参数, N, 表示与入射光束有关的基模 高斯光束的菲涅耳数。则(4)式可改写为:



激光技术 jgjs@sina.com

$$\int_{0}^{\sqrt{y}} \int_{0}^{\sqrt{y}} H_{m}(\sqrt{2} x_{1}) H_{n}(\sqrt{2} y_{1}) \exp[-(x_{1}^{2} + y_{1}^{2})] \times \exp\left\{-\frac{i N_{w} Z' f}{\left[1 + \frac{Z}{f}\left(1 - \frac{s}{f}\right)\right]}(x_{1}^{2} + y_{1}^{2})\right\} dx_{1} dy_{1}$$
(7)

轴上光强为: $I_{mn} = E_{mn} \cdot E_{mn}^{*}$ (8)

2 厄米-高斯光束通过光阑-透镜分离系统的 焦移

轴上光强极大值点满足: $dI_{mn}/dZ = 0$ (9) 轴上光强极大值点位置 Z_{max} 由上式确定。

在弱截断情况下,即 $\gg 1(a \gg w_0)^{[3,6]}, 衍射$ 效应可以忽略,几何成像公式 $1/R_2 - 1/R_1 = -1/f$ 近似成立,其中 R_1, R_2 为透镜入射和出射波面曲率 半径,可得:

$$R_{2} = s + \left(\frac{fN_{w}}{s} \right)^{2} 1 - \frac{s}{f} + \frac{2fN_{w}^{2}}{s} \right] (10)$$

铀上点相对几何焦点的相对位置为:

 $Z = [/ f + Z/ - / R_2 /]/ / R_2 |$ (11) 光强最大值的相对焦移为:

 $z_{f} = [/ f + Z_{max} / - / R_{2} /] / / R_{2} |$ (12) 当 *m* 和 *n* 均为 0,且 *s*/*f* = 0(即光阑与透镜处于同 一平面),可得: $z_{f} = -1/(1 + {}^{2}N_{w}{}^{2})$ (13) 则回到文献[3]中弱截断情况下的结果。

在强截断情况下,可直接利用(7)式和(8)式进 行数值计算得到轴上光强分布,进而可得到焦移。 由(7)式看出,轴上光强和焦移受 *s/f*、菲涅耳数 *N*_w 和截断参数 的影响。

3 数值计算和分析

利用(7) ~ (12) 式进行数值计算并作图如下。 图 2 是 =4, N_w = 2 时 TEM₀₀, TEM₀₂, TEM₂₂模的 轴上光强分布。从图 2 可看出, 和 N_w 一定时,轴



Fig. 2 Axial intensity distribution of Hermiter Gaussian beams a -m = 0, n = 0 b -m = 0, n = 2 c -m = 2, n = 2

上光强极大值 I_{max} 随 s/f 的增大而右移,即远离透 镜。对不同的 s/f,TEM₀₀模的轴上光强都呈对称 分布,而 TEM₀₂和 TEM₂₂模的轴上光强只在 s/f =1 时呈对称分布。在 s/f = 1 处,TEM₂₂模的轴上光 强存在数值相等的两个极大值,并且相对几何焦点 对称。另外,几何焦点的光强与极大值光强的差值 仅约为 8 %,从而在 - 0.14 < Z < 0.14的较大范围 内可获得光强差值为 8 %的极大光强区域。

图 3 是 =4, N_w = 2 时 TEM₀₀, TEM₀₂, TEM₂₂ 模的相对焦移 z_f 随光阑-透镜分离程度 s/f 的变 化。由图 3 可知,在 和 N_w 不变的情况下,焦移与 模序数有关,并且随 s/f 的变化可大于、等于或小 于 0。s/f = 1 是焦移变化的转折点。s/f < 1 时, | z_f | 随 s/f 的增大而减小, s/f > 1 时, | z_f | 随 s/f的增大而增大。在 s/f = 1 处, TEM₀₀和 TEM₀₂ 模的焦移为 0,而 TEM₂₂模则存在相对几何焦点对 称的两个焦移点。



Fig. 3 Relative focal shift z_f varies with s/f



Fig. 4 Relative focal shift z_f varies with Fresnel number N_w

图 4 和图 5 是 TEM₂₂模的相对焦移 z_f 随 N_w , 的变化。从图中看出, z_f 随 N_w , 的增大 而减小。当 s/f = 1 时, z_f 在大于 0 和小于 0 的 区域有变化相同的曲线。图 6 是 = 4, $N_w = 2$ 时 TEM₀₀, TEM₀₂, TEM₂₂模的轴上光强极大值 I_{max} 随 s/f 的变化。由图可知, 和 N_w 一定时, s/f = 1 同 样是光强极大值 I_{max} 变化的转折点。s/f < 1 时, I_{\max} 随 s/f的增大而减小, s/f > 1时, I_{\max} 随 s/f的 增大而增大。在 s/f = 1处, I_{\max} 为最小值。



Fig. 5 Relative focal shift z_f varies with truncation parameter



Fig. 6 Maximum axial intensity I_{max} varies with s/f

4 小 结

使用 Collins 公式研究了厄米-高斯光束通过光 阑-透镜分离光学系统的聚焦特性。由分析得出,光 阑-透镜分离程度 s/f、菲涅耳数和截断参数影响相 对焦移的大小、轴上光强分布和轴上光强极大值 *I*max的大小。随 s/f 的变化,相对焦移可大于、等于 或小于 0。尤其对于 TEM₂₂模厄米-高斯光束,在几 何焦面两边存在两个相等且相对几何焦点对称的轴 上极大光强,因此,存在两个符号相反的焦移。

参考文献

- [1] 吕百达. 强激光的传输与控制. 北京:国防工业出版社,1999.
- [2] Li Y, Wolf E. Opt Commun, 1981, 39(4):211~215.
- [3] Li Y, Wolf E. Opt Commun, 1982, 42(3):151~156.
- [4] Carter W H. Appl Opt ,1982 ,21(11) :1989 ~ 1994.
- [5] Givens P M. Opt Commun, 1982, 41:145 ~ 148.
- [6] Belland P, Crenn J P. Appl Opt ,1982 ,21 :522 ~ 527.
- [7] 黄文龙,吕百达.四川大学学报(自然科学版),1994,31(4):471 ~475.
- [8] 王喜庆,吕百达. 激光技术,1996,20(3):185~190.
- [9] Carter W H, Aburdence M F. J O S A, 1987, A4 (10) : 1949 ~ 1952.
- [10]~Lü
BD,Huang W,Zhang B et al. Optick ,1995 ,
99 :8 ~ 12.
- [11] Wenzel R G.J O S A ,1987 ,A4(2) :340 ~ 345.
- [12] Collins S A Jr. J O S A ,1970 ,60(9) : 1168 ~ 1177.